

# PICOSUN™ P-300B

PICOSUN™ P-300B ALD系統專門用於生產印表機列印頭、感測器和麥克風等MEMS元件及對鏡片、光學器件、機械部件、珠寶、硬幣和醫療植入器械等3D物件進行批量塗層加工。



## 技術特徵

PICOSUN™ P-300 ALD系統的出現重新定義了ALD高產量製造標準。我們將經專利註冊的熱腔壁設計與完全獨立的前驅物管線結合，可高產量製造出低微粒、電學和光學性能優越的頂級ALD薄膜。設計靈活，維護輕鬆、快捷，使得該系統成為市場上停運時間最短、運作成本最低的ALD系統。另外，我們具備擴散增強專利技術Picoflow™，能通過各種製程驗證，在超高深寬比基體表面製造出高度適形塗層。

PICOSUN™ P-300B ALD系統專用於在MEMS和3D部件生產中進行批量塗層加工。該系統維護快捷、高度可靠且極其輕鬆。

### 典型基板尺寸和類型

- 200 mm晶片，每批25片，採用標準間距
- 150 mm晶片，每批50片，採用標準間距
- 100 mm晶片，每批75片，採用標準間距
- 非晶片基板（定制支撐架）
- 高深寬比（最高達1:2500）樣品

### 製程溫度

- 50到500°C

### 典型製程

- 週期時間低至幾秒\*的有效批量加工製程
- $Al_2O_3$ 、 $SiO_2$ 、 $Ta_2O_5$ 、 $HfO_2$ 、 $ZnO$ 、 $TiO_2$ 、 $ZrO_2$ 、 $AlN$ 、 $TiN$ 和各種金屬
- 同一批中，非均勻性低至1%  $1\sigma$ 以下（ $Al_2O_3$ ，WIW，WTW，B2B，49 pts，5mm EE）\*\*

### 基板裝載

- 用氣動升降機手動裝載
- 線性半自動裝載
- 工業機械裝置

### 前驅物

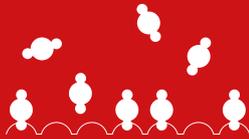
- 液態、固態、氣態和臭氧
- 前驅物餘量感測器，提供清洗和填裝前驅物服務
- 4根獨立前驅物管線，最多可載入8個前驅物

\*週期時間<10S  
\*\*不均勻性<1%

如欲瞭解更多資訊或報價，請隨時聯繫我們。

**picosun**  
AGILE ALD

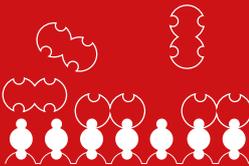
## ALD的原理



引入含A元素的分子。



表面吸附分子。



引入含B元素的分子，  
與表面的A元素反應。



形成AB化合物單分子層。

重複該過程，直至薄膜厚度符合預期。

**picosun**  
AGILE ALD

### PICOSUN總部

#### Picosun公司

地址：Tietotie 3

FI-02150 Espoo, Finland

電話：+358 50 321 1955

電子郵件：info@picosun.com

#### Picosun公司

地址：Masalantie 365

FI-02430 Masala, Finland

電話：+358 50 321 1955

電子郵件：info@picosun.com

### PICOSUN分公司

#### Picosun（歐洲）有限責任公司

電話：+49 1522 449 49 11

電子郵件：sales@picosun.com

#### Picosun（美國）有限責任公司

電話：+1 214 790 0844

手機：+1 214 490 3951

電子郵件：sales@picosun.com

#### 新加坡Picosun（亞洲）有限公司

電話：+65 9756 3265

電子郵件：sales@picosun.com

#### Picosun（臺灣）有限公司

電話：+886 90 515 2985

電子郵件：sales@picosun.com

#### Picosun（中國）有限公司

電話：+358 40 480 3449

電子郵件：sales@picosun.com

#### Picosun（日本）有限公司

電話：+81 3 6431 9500

手機：+81 90 5198 8131

電子郵件：sales@picosun.com